

ライカマイクロシステムズは
さまざまな分野における電子顕微鏡の試料作製フローを
フルサポートしたソリューションをご提供します。

工業用試料 作製装置	
ウルトラマイクローム	UC Enuity
ガラスナイフ作製	EM KMR3 EM MP
トリミング	EM RAPID EM TXP
錠剤ミリング	EM RAPID
高圧凍結/急速凍結	EM ICE EM GP2
クライオ共焦点顕微鏡システム	STELLARIS Cryo
凍結切断/フリーズエッチング/ クライオコーティング	EM ACE600
凍結切断/フリーズエッチング/ レプリカ作製	EM ACE900
真空クライオトランスファー	EM VCT500 EM VCM
コーティング	EM ACE600
イオンミリング	EM TIC 3X

生物学用試料 作製装置	
ウルトラマイクローム	UC Enuity
トリミング	EM RAPID
ガラスナイフ作製	EM KMR3 EM MP
染色	EM AC20
プロセッサ	EM TP EM AFS2/EM FSP
高圧凍結/急速凍結	EM ICE EM GP2
クライオ共焦点顕微鏡システム	STELLARIS Cryo
凍結切断/フリーズエッチング/ クライオコーティング	EM ACE600
凍結切断/フリーズエッチング/ レプリカ作製	EM ACE900
真空クライオトランスファー	EM VCT500 EM VCM
コーティング	EM ACE600
臨界点乾燥	EM CPD300

From Eye to Insight



ライカ マイクロシステムズ株式会社

本社
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-29-9
Tel.03-6758-5656 Fax.03-5155-4333
大阪セールスオフィス
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎 5-4-9 商業第2ビル10F
Tel.06-6374-9771 Fax.06-6374-9772
名古屋セールスオフィス
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 2-3-31 CK22キリン広小路ビル5F
Tel.052-222-3939 Fax.052-222-3784
福岡セールスオフィス
〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町8-30 博多フコク生命ビル12F
Tel.092-282-9771 Fax.092-282-9772
<https://www.leica-microsystems.com/jp/>
Email:lmc@leica-microsystems.com



お問合せはこちら

ご依頼・お問い合わせは私までお気軽にお声がけください。

電子顕微鏡用試料作製装置 ライカのシームレスなラインアップ

1 TEM、SEM、IRイメージング用トリミング装置 EM RAPID

整形 トリミング 錠剤ミリング

ウルトラマイクロームの前処理に最適な高速トリミング装置です。

- 安全なトリミングが可能
- 作業はすべて実体顕微鏡で観察しながら行うことが可能
- 錠剤内部のIRイメージング用にドライミリングで断面作製ができます。



2 ターゲット断面試料作製装置 EM TXP

整形 トリミング 切断 研磨
3mmφディスク打ち抜き 錠剤ミリング

ウルトラマイクローム用のトリミング機能に加え、硬質材料の切断、研磨、さらに錠剤ミリングも可能なマルチシステムです。

- 微小ターゲットを狙って正確な断面作製が可能
- 高性能実体顕微鏡による観察
- 断面の鏡面研磨工程は、自動制御で行うことが可能



3 トリプليونミリング装置 EM TIC 3X

イオンミリング/クライオイオンミリング

さまざまな材料で高品質な断面を作製。高性能クライオステージにより、熱ダメージを受けやすい試料の加工も得意です。

- トリプليونビームで高速 (Si、300 μm/h)、広範囲 (幅4 mm、深さ1 mm) に加工。
- 液体窒素による試料冷却 (冷却温度範囲: -160°C ~ 30°C)
- 最大3個の自動加工 (マルチサンプルステージ)
- 大面積試料のフラットミリング (ロータリーステージ)
- VCTクロスリンクにより、凍結装置からのクライオワークフローおよび大気非暴露試料作製に対応



4 高真空コーティング装置 EM ACE600

スパッタコーティング カーボン蒸着 親水化処理 凍結切断
フリーズエッチング クライオコーティング

さまざまな金属やカーボンをコーティング源として、非常に薄く均質で粒状性の良いコーティングが可能。FE-SEM、FIB、TEMによる高分解能観察に適用できます。EM ACE600では次の構成が可能です。

- スパッタリング ●カーボンスレッド蒸着
- 親水化処理機能 ●フリーズフラクチャーシステム
- フリーズエッチング
- EM VCT500との接続が可能です。SEM、FIB-SEM、XPS、SIMSなどの真空装置のほか、クライオマイクローム、グローブボックスとリンクすることができ、クライオワークフローや大気非暴露系の前処理ソリューションを提供できます。



5 真空クライオトランスファー装置 EM VCT500

真空クライオ搬送 大気非暴露搬送

EM VCT500は、コンタミネーションフリーで試料作製装置と各種分析装置とのクロスリンクが可能な、真空クライオトランスファーシステムです。

- VCT500ロードロックはSEM、FIB-SEM、XPS、SIMSなどの真空分析装置のほか、クライオマイクローム、グローブボックスにもセット可能。
- 試料をコンタミネーションフリーでクライオ搬送できます
- Arガスなどの不活性ガスをパージしての搬送にも対応



クライオSEM試料作製のベストコンビネーション

ライカ
EM ACE600
+
EM VCT500



6 VCT対応多機能クライオワークステーション EM VCM

クライオワークステーション

- VCTシャトルの試料の着脱の他、さまざまな凍結試料の前処理に幅広く対応



7 フリーズレプリカ作製装置 EM ACE900

凍結切断 フリーズエッチング シャドウイング レプリカ作製

- ロードロック機構により、凍結試料の装置導入時の温度上昇を抑えることができます。
- マイクローム型切断機構とプログラム可能なフリーズエッチング機能により、再現性の良い試料作製が可能。
- Pt-CのEビーム蒸着と角度可変ステージにより、任意の角度でシャドウイングができます。
- VCT500真空クライオトランスファー装置と接続が可能



8 超薄切片作製用ウルトラマイクローム UC Enuity

超薄切片作製 高品質な断面作製

生物系試料や材料系試料の高品質な超薄切片、および断面を作製する装置です。

- 起動時のイニシャライズを含め、各種自走系機能の設定を包括して、自動セットアップ
- 各種ソフトウェアパッケージでアプリケーションに合わせた機能を追加できる拡張性
- VolumeEM向け高品質リボン状超薄切片を、基板上に容易に回収
- 蛍光実体顕微鏡観察像やμCTスキャンデータを用いたターゲットのトリミングなど、先進的な拡張性



9 凍結切削用クライオウルトラマイクローム UC Enuity + Cryo Chamber

凍結超薄切片作製 高品質な断面作製

UC Enuityクライオチャンバーは、UC Enuityで凍結切削を行うための専用の凍結切削システムです。優れた温度制御、安定性、操作性により高品質な凍結切片を作製できます。

- 精密な温度制御により、試料、ナイフ、ガスを最適な冷却状態に保つことができます。
- マイクロコンピューターとEM CRION が凍結切削と凍結切片の操作に安定性とフレキシビリティをもたらします。
- クライオスフェアが試料やナイフへの霜の付着を最小限に抑えます。
- VCTクロスリンクにより、SEM、XPS、SIMSなどへのクライオワークフローに対応。



10 ガラスナイフメーカー EM KMR3

ガラスナイフ作製

- 学生、初心者から経験豊富なウルトラマイクロームユーザーまで、高品質なガラスナイフ作製に最適な装置です。
- 正確なcorner-to-cornerブレイクで、ナイフの角度をできるだけ45°に近づけることができます。
- バランス切断法により、6.4/8mm、または8/10mmのガラスストリップ (ガラス棒) から、再現性良く高品質なガラスナイフを作製。



11 自動電子染色装置 EM AC20

切片染色

- 生物用TEM用超薄切片の自動染色装置です。
- 高い安全性を確保・試薬の消費量を低減
- 高コントラストを実現 ●再現性を向上



12 自動浸漬凍結装置 EM GP2

浸漬凍結

- プログラム制御された環境チャンバーとプロットティングにより、再現性の良い浸漬凍結ができます。
- 独自技術の液化ヘッドを使用して二次冷却剤を迅速、簡単、安全に注入
- 片面平行プロットティングより、均等な膜厚を実現



13 クライオ共焦点顕微鏡システム STELLARIS Cryo

電顕/光顕相関

浸漬凍結試料の光電子相関顕微鏡法 (CLEM) のためのクライオ共焦点顕微鏡システム。蛍光標識したターゲット構造の位置を極低温下で特定することで、クライオETのラメラ作製の精度とクライオTEM観察の効率が向上します。

- 195°Cまで冷却可能なクライオステージとクライオ対応レンズ (50x/WVD 0.28 mm/NA 0.9) により、極低温下で安定した高分解能観察を実現。



- 専用クライオトランスファーシャトルが、試料を極低温に保ちながら、シンプルに装填・搬送
- Power HyD detectorと適応型抽出プロセスLIGHTNINGで、対象構造を精密に3Dターゲットング
- 蛍光の色情報に加え、TauSenseテクノロジーが様々な蛍光寿命 により多くの情報を抽出

14 高圧凍結装置 EM ICE

高圧凍結

氷晶を発生させることなく、最大厚み200 μm、直径5 mmまでの試料を凍結可能な高圧凍結装置です。

- 氷晶防止剤が不要
- 懸濁液や単層細胞培養、細胞組織の凍結固定が可能・凍結までの処理時間を短縮
- 再現性の高い凍結が可能・簡単なワンボタン操作
- LM/EM の相関をとるCLEM研究に最適
- 光刺激・電気刺激と連動した高圧凍結 (オプション)



15 凍結置換装置 EM AFS2

凍結置換

光学顕微鏡や電子顕微鏡用の凍結置換と、低温下での樹脂包埋が可能です。

- 使用温度範囲: -140°C ~ +70°C
- トランスファー機能搭載
- 紫外線重合が可能
- 直感的なプログラミングが可能
- 凍結置換専用プロセッサFSPによりラボオートメーションを実現 (オプション)



16 自動ルーチン用ティッシュプロセッサ EM TP

固定 脱水 置換

- 安全性を向上
- 自動化によるタイムセービング
- 再現性を向上



17 自動臨界点乾燥装置 EM CPD300

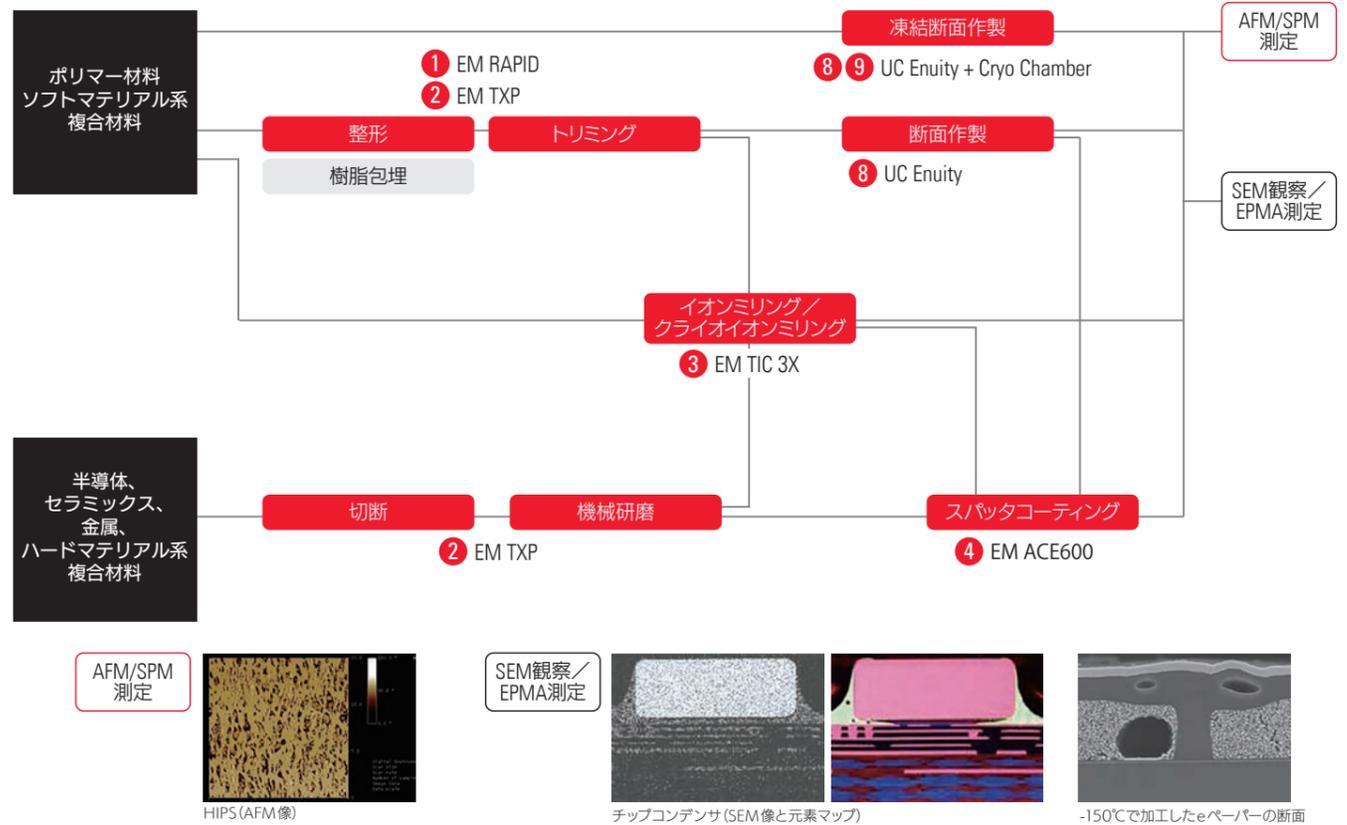
臨界点乾燥

二酸化炭素の臨界点状態での自動乾燥処理が、固定した生物試料および含水材料を水の表面張力による変形を防ぎ、再現性良く構造保存性に優れた乾燥を行います。

- 全自動制御されたプロセスで、再現性の良い臨界点乾燥を実現。
- フィルターコンセプトによりCO2の消費量および処理時間の短縮が図れます
- 廃液分離装置内蔵で、安全で簡単に廃液処理が可能です
- 多彩な試料ホルダーにより生物試料、MEMSなどさまざまなニーズに合わせて乾燥できます



材料系試料のSEM/EPMA用断面、AFM/SPM用試料



1 TEM、SEM、IRイメージング用トリミング装置 EM RAPID

整形 トリミング 錠剤ミリング

ウルトラマイクロトームの前処理に最適な高速トリミング装置です。

- 安全なトリミングが可能
- 作業はすべて実体顕微鏡で観察しながら行うことが可能
- 錠剤内部のIRイメージング用にドライミリングで断面作製ができます。



2 ターゲット断面試料作製装置 EM TXP

整形 トリミング 切断 研磨
3mmφディスク打ち抜き 錠剤ミリング

ウルトラマイクロトーム用のトリミング機能に加え、硬質材料の切断、研磨、さらに錠剤ミリングも可能なマルチシステムです。

- 微小ターゲットを狙って正確な断面作製が可能
- 高性能実体顕微鏡による観察
- 断面の鏡面研磨工程は、自動制御で行うことが可能



3 トリプリーオンミリング装置 EM TIC 3X

イオンミリング/クライオイオンミリング

さまざまな材料で高品質な断面を作製。高性能クライオステージにより、熱ダメージを受けやすい試料の加工も得意です。

- トリプリーオンビームで高速 (Si, 300 μm/h)、広範囲 (幅4 mm、深さ1 mm) に加工。
- 液体窒素による試料冷却 (冷却温度範囲: -160°C ~ 30°C)
- 最大3個の自動加工 (マルチサンプルステージ)
- 大面積試料のフラットミリング (ロータリーステージ)
- VCTクロスリンクにより、凍結装置からのクライオワークフローおよび大気非暴露試料作製に対応



4 高真空コーティング装置 EM ACE600

スパッタコーティング カーボン蒸着 親水化処理 凍結切断
フリーズエッチング クライオコーティング

さまざまな金属やカーボンコーティング源として、非常に薄く均質で粒状性の良いコーティングが可能。FE-SEM、FIB、TEMによる高分解能観察に適用できます。EM ACE600では次の構成が可能です。

- スパッタリング
- カーボンスレッド蒸着
- 親水化処理機能
- フリーズフラクチャーシステム
- フリーズエッチング
- EM VCT500との接続が可能です。SEM、FIB-SEM、XPS、SIMSなどの真空装置のほか、クライオマイクロトーム、グローブボックスとリンクすることができ、クライオワークフローや大気非暴露系の前処理ソリューションを提供できます。



5 真空クライオトランスファー装置 EM VCT500

真空クライオ搬送 大気非暴露搬送

EM VCT500は、コンタミネーションフリーで試料作製装置と各種分析装置とのクロスリンクが可能な、真空クライオトランスファーシステムです。

- VCT500ロードロックはSEM、FIB-SEM、XPS、SIMSなどの真空分析装置のほか、クライオマイクロトーム、グローブボックスにもセット可能。
- 試料をコンタミネーションフリーでクライオ搬送できます
- Arガスなどの不活性ガスをパージしての搬送にも対応



クライオSEM試料作製のベストコンビネーション

ライカ
EM ACE600
+
EM VCT500



8 超薄切片作製用ウルトラマイクロトーム UC Enuity

超薄切片作製 高品質な断面作製

生物系試料や材料系試料の高品質な超薄切片、および断面を作製する装置です。

- 起動時のイニシャライズを含め、各種自走系機能の設定を包括して、自動セットアップ
- 各種ソフトウェアパッケージでアプリケーションに合わせた機能を追加できる拡張性
- VolumeEM向け高品質リボン状超薄切片を、基板上に容易に回収
- 蛍光実体顕微鏡観察像やμCTスキャンデータを用いたターゲットのトリミングなど、先進的な拡張性



9 凍結切削用クライオウルトラマイクロトーム UC Enuity + Cryo Chamber

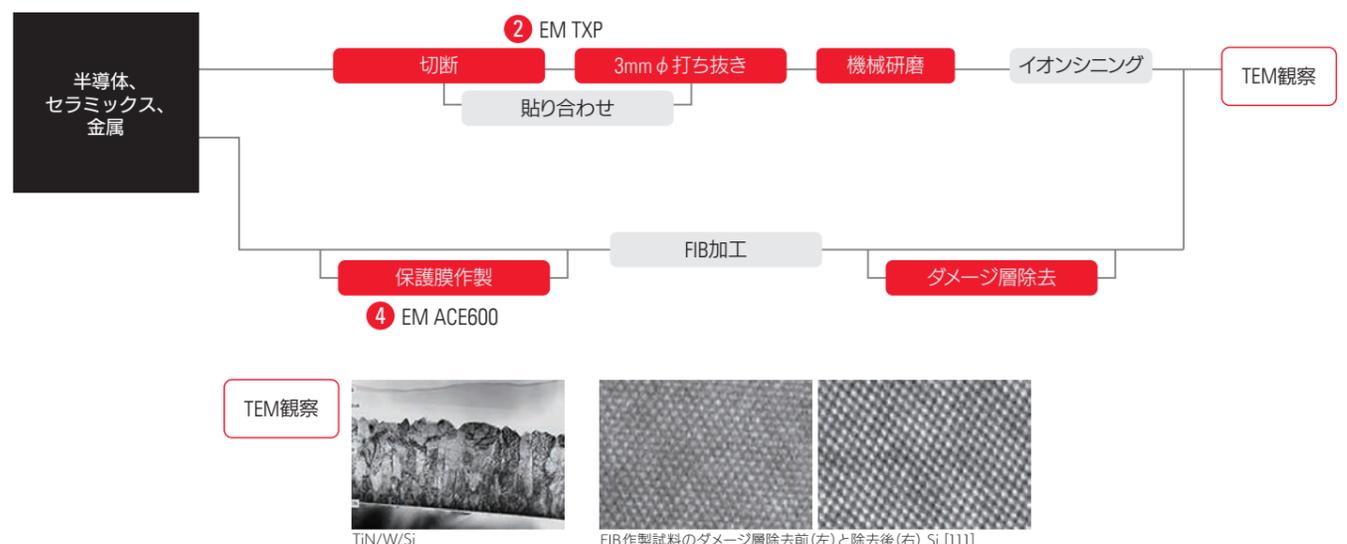
凍結超薄切片作製 高品質な断面作製

UC Enuityクライオチャンバーは、UC Enuityで凍結切削を行うための専用の凍結切削システムです。優れた温度制御、安定性、操作性により高品質な凍結切片を作製できます。

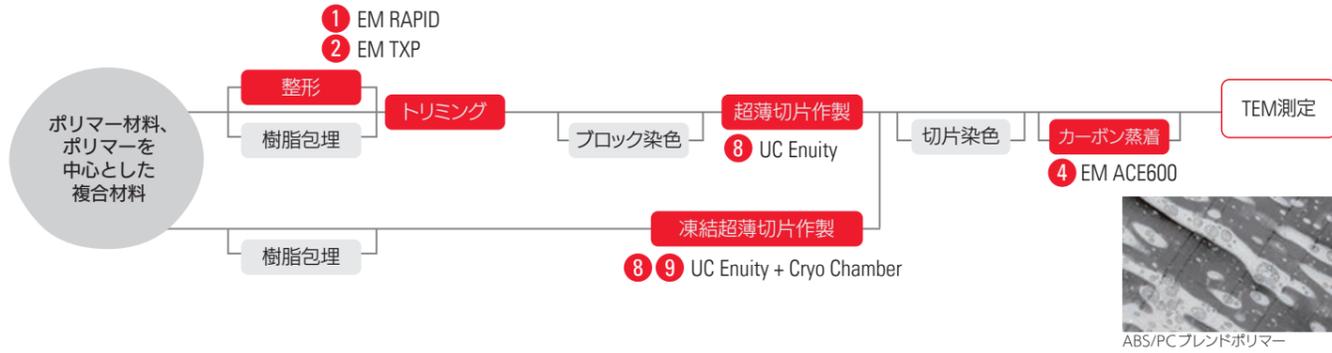
- 精密な温度制御により、試料、ナイフ、ガスを最適な冷却状態に保つことができます。
- マイクロマニピュレーターとEM CRION が凍結切削と凍結切片の操作に安定性とフレキシビリティをもたらします。
- クライオスフェアが試料やナイフへの霜の付着を最小限に抑えます。
- VCTクロスリンクにより、SEM、XPS、SIMSなどへのクライオワークフローに対応。



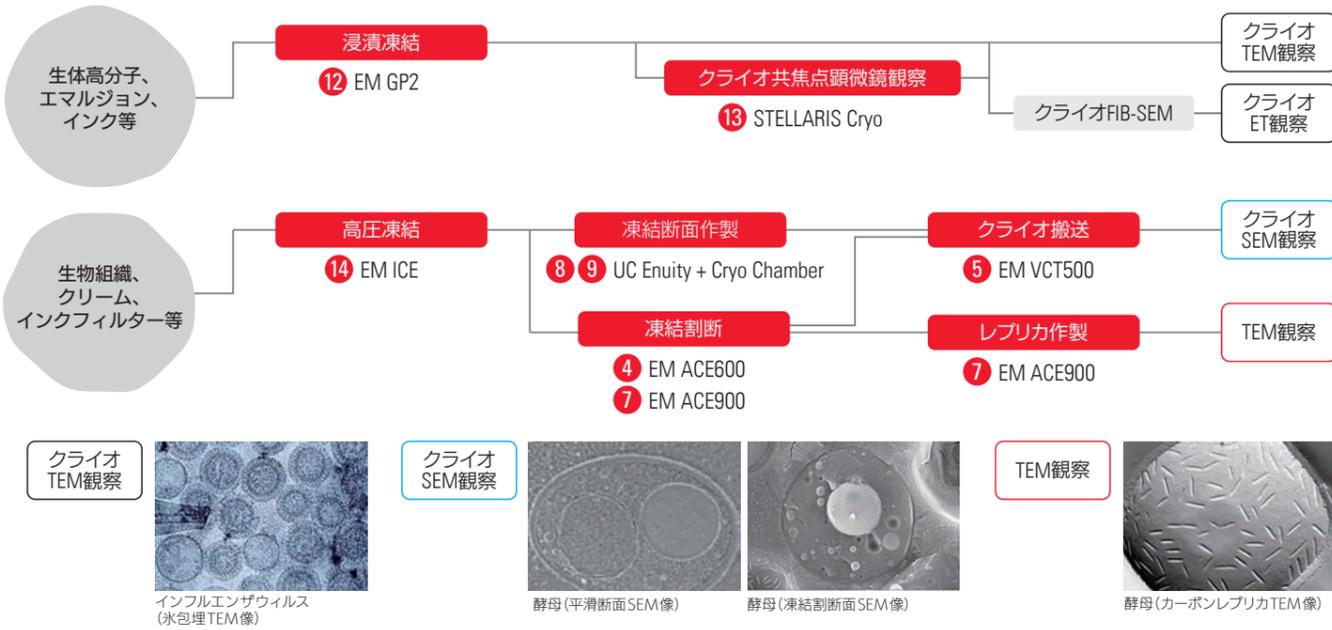
材料系ハードマテリアルのTEM用試料作製



材料系ソフトマテリアルのTEM用試料作製



含水試料、懸濁試料のSEM、TEM用試料作製 (生物系、材料系共通)



1 TEM、SEM、IRイメージング用トリミング装置 EM RAPID

整形 トリミング 錠剤ミリング

ウルトラマイクロトームの前処理に最適な高速トリミング装置です。

- 安全なトリミングが可能
- 作業はすべて実体顕微鏡で観察しながら行うことが可能
- 錠剤内部のIRイメージング用にドライミリングで断面作製ができます。



2 ターゲット断面試料作製装置 EM TXP

整形 トリミング 切断 研磨

3mmφディスク打ち抜き 錠剤ミリング

ウルトラマイクロトーム用のトリミング機能に加え、硬質材料の切断、研磨、さらに錠剤ミリングも可能なマルチシステムです。

- 微小ターゲットを狙って正確な断面作製が可能
- 高性能実体顕微鏡による観察
- 断面の鏡面研磨工程は、自動制御で行うことが可能



4 高真空コーティング装置 EM ACE600

スパッタコーティング カーボン蒸着 親水化処理 凍結割断
フリーズエッチング クライオコーティング

さまざまな金属やカーボンをコーティング源として、非常に薄く均質で粒状性の良いコーティングが可能。FE-SEM、FIB、TEMによる高分解能観察に適応できます。EM ACE600では次の構成が可能です。

- スパッタリング
- カーボンスレッド蒸着
- 親水化処理機能
- フリーズフラクチャーシステム
- フリーズエッチング
- EM VCT500との接続が可能です。SEM、FIB-SEM、XPS、SIMSなどの真空装置のほか、クライオマイクロトーム、グローブボックスとリンクすることができ、クライオワークフローや大気非暴露系の前処理ソリューションを提供できます。



5 真空クライオトランスファー装置 EM VCT500

真空クライオ搬送 大気非暴露搬送

EM VCT500は、コンタミネーションフリーで試料作製装置と各種分析装置とのクロスリンクが可能な、真空クライオトランスファーシステムです。

- VCT500ロードロックはSEM、FIB-SEM、XPS、SIMSなどの真空分析装置のほか、クライオマイクロトーム、グローブボックスにもセット可能。
- 試料をコンタミネーションフリーでクライオ搬送できます
- Arガスなどの不活性ガスをパージしての搬送にも対応



クライオSEM試料作製のベストコンビネーション

ライカ
EM ACE600
+
EM VCT500



6 VCT対応多機能クライオワークステーション EM VCM

クライオワークステーション

- VCTシャトルの試料の着脱の他、さまざまな凍結試料の前処理に幅広く対応



7 フリーズレプリカ作製装置 EM ACE900

凍結割断 フリーズエッチング シャドウイング レプリカ作製

- ロードロック機構により、凍結試料の装置導入時の温度上昇を抑えることができます。
- マイクロトーム型割断機構とプログラム可能なフリーズエッチング機能により、再現性の良い試料作製が可能。
- Pt-CのEビーム蒸着と角度可変ステージにより、任意の角度でシャドウイングができます。
- VCT500真空クライオトランスファー装置と接続が可能



8 超薄切片作製用ウルトラマイクロトーム UC Enuity

超薄切片作製 高品質な断面作製

生物系試料や材料系試料の高品質な超薄切片、および断面を作製する装置です。

- 起動時のイニシャライズを含め、各種自走系機能の設定を包括して、自動セットアップ
- 各種ソフトウェアパッケージでアプリケーションに合わせた機能を追加できる拡張性
- VolumeEM向け高品質リボン状超薄切片を、基板上に容易に回収
- 蛍光実体顕微鏡観察像やμCTスキャンデータを用いたターゲットのトリミングなど、先進的な拡張性



9 凍結切削用クライオウルトラマイクロトーム UC Enuity + Cryo Chamber

凍結超薄切片作製 高品質な断面作製

UC Enuityクライオチャンバーは、UC Enuityで凍結切削を行うための専用の凍結切削システムです。優れた温度制御、安定性、操作性により高品質な凍結切片を作製できます。

- 精密な温度制御により、試料、ナイフ、ガスを最適な冷却状態に保つことができます。
- マイクロマニピュレーターとEM CRION が凍結切削と凍結切片の操作に安定性とフレキシビリティをもたらします。
- クライオスフェアが試料やナイフへの霜の付着を最小限に抑えます。
- VCTクロスリンクにより、SEM、XPS、SIMSなどへのクライオワークフローに対応。



12 自動浸漬凍結装置 EM GP2

浸漬凍結

- プログラム制御された環境チャンバーとプロッタリングにより、再現性の良い浸漬凍結ができます。
- 独自技術の液化ヘッドを使用して二次冷却剤を迅速、簡単、安全に注入
- 片面平行プロッタリングより、均等な膜厚を実現



13 クライオ共焦点顕微鏡システム STELLARIS Cryo

電顕/光顕相関

浸漬凍結試料の光電子相関顕微鏡法 (CLEM) のためのクライオ共焦点顕微鏡システム。蛍光標識したターゲット構造の位置を極低温で特定することで、クライオETのラメラ作製の精度とクライオTEM観察の効率が向上します。

- 195°Cまで冷却可能なクライオステージとクライオ対応レンズ (50x/WD 0.28 mm/NA 0.9) により、極低温で安定した高分解能観察を実現。
- 専用クライオトランスファーシャトルが、試料を極低温に保ちながら、シンプルに装填・搬送
- Power HyD detectorと適応型抽出プロセスLIGHTNINGで、対象構造を精密に3Dターゲットリング
- 蛍光の色情報に加え、TauSenseテクノロジーが様々な蛍光寿命でより多くの情報を抽出



14 高圧凍結装置 EM ICE

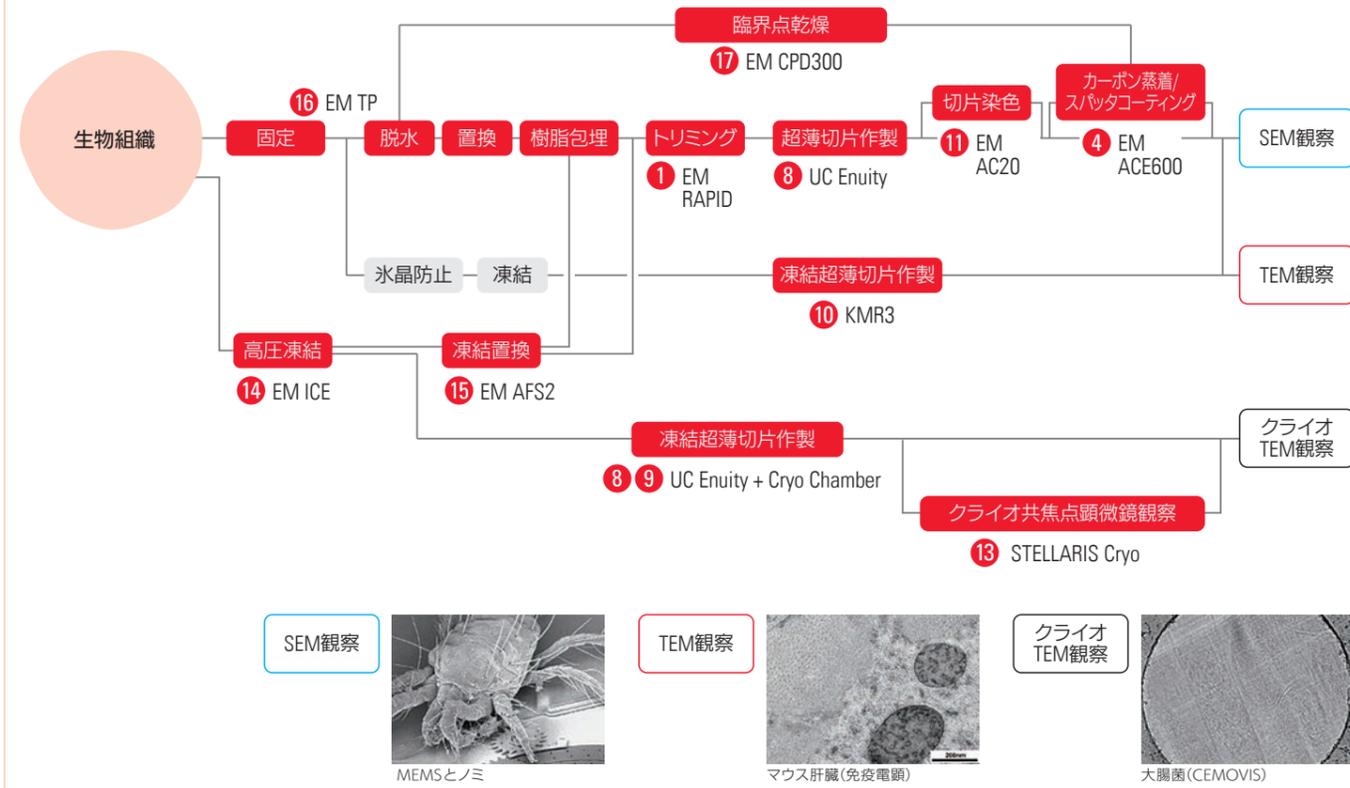
高圧凍結

氷晶を発生させることなく、最大厚み200 μm、直径5 mmまでの試料を凍結可能な高圧凍結装置です。

- 氷晶防止剤が不要
- 懸濁液や単層細胞培養、細胞組織の凍結固定が可能・凍結までの処理時間を短縮
- 再現性の高い凍結が可能・簡単なワンボタン操作
- LM/EM の相関をとるCLEM研究に最適
- 光刺激・電気刺激と連動した高圧凍結 (オプション)



生物組織のTEM/SEM用試料作製



1 TEM、SEM、IRイメージング用トリミング装置
EM RAPID

整形 トリミング 錠剤ミリング

ウルトラマイクロームの前処理に最適な高速トリミング装置です。

- 安全なトリミングが可能
- 作業はすべて実体顕微鏡で観察しながら行うことが可能
- 錠剤内部のIRイメージング用にドライミリングで断面作製ができます。

4 高真空コーティング装置
EM ACE600

スパッタコーティング カーボン蒸着 親水化処理 凍結割断
フリーズエッチング クライオコーティング

さまざまな金属やカーボンをコーティング源として、非常に薄く均質で粒状性の良いコーティングが可能。FE-SEM、FIB、TEMによる高分解能観察に適応できます。EM ACE600では次の構成が可能です。

- スパッタリング ●カーボンスレッド蒸着
- 親水化処理機能 ●フリーズフラクチャーシステム
- フリーズエッチング
- EM VCT500との接続が可能です。SEM、FIB-SEM、XPS、SIMSなどの真空装置のほか、クライオマイクローム、グローブボックスとリンクすることができ、クライオワークフローや大気非暴露系の前処理ソリューションを提供できます。

8 超薄切片作製用ウルトラマイクローム
UC Enuity

超薄切片作製 高品質な断面作製

生物系試料や材料系試料の高品質な超薄切片、および断面を作製する装置です。

- 起動時のイニシャライズを含め、各種自走系機能の設定を包括して、自動セットアップ
- 各種ソフトウェアパッケージでアプリケーションに合わせた機能を追加できる拡張性
- VolumeEM向け高品質リボン状超薄切片を、基板上に容易に回収
- 蛍光実体顕微鏡観察像やμCTスキャナーデータを用いたターゲットのトリミングなど、先進的な拡張性

9 凍結切削用クライオウルトラマイクローム
UC Enuity + Cryo Chamber

凍結超薄切片作製 高品質な断面作製

UC Enuityクライオチャンバーは、UC Enuityで凍結切削を行うための専用の凍結切削システムです。優れた温度制御、安定性、操作性により高品質な凍結切片を作製できます。

- 精密な温度制御により、試料、ナイフ、ガスを最適な冷却状態に保つことができます。
- マイクロコンピューターとEM CRION が凍結切削と凍結切片の操作に安定性とフレキシビリティをもたらします。
- クライオスフェアが試料やナイフへの霜の付着を最小限に抑えます。
- VCTクロスリンクにより、SEM、XPS、SIMSなどへのクライオワークフローに対応。

10 ガラスナイフメーカー
EM KMR3

ガラスナイフ作製

- 学生、初心者から経験豊富なウルトラマイクロームユーザーまで、高品質なガラスナイフ作製に最適な装置です。
- 正確なcorner-to-cornerブレイクで、ナイフの角度をできるだけ45°に近づけることができます。
- バランス切断法により、6.4/8mm、または8/10mmのガラスストリップ(ガラス棒)から、再現性良く高品質なガラスナイフを作製。

11 自動電子染色装置
EM AC20

切片染色

生物用TEM用超薄切片の自動染色装置です。

- 高い安全性を確保・試薬の消費量を低減
- 高コントラストを実現
- 再現性を向上

13 クライオ共焦点顕微鏡システム
STELLARIS Cryo

電顕/光顕相関

浸漬凍結試料の光電子相関顕微鏡法(CLEM)のためのクライオ共焦点顕微鏡システム。蛍光標識したターゲット構造の位置を極低温で特定することで、クライオETのラメラ作製の精度とクライオTEM観察の効率が向上します。

- 195℃まで冷却可能なクライオステージとクライオ対応レンズ(50x/WD 0.28 mm/NA 0.9)により、極低温で安定した高分解能観察を実現。
- 専用クライオトランスファーシャトルが、試料を極低温に保ちながら、シンプルに装填・搬送
- Power HyD detectorと適応型抽出プロセスLIGHTNINGで、対象構造を精密に3Dターゲットング
- 蛍光の色情報に加え、TauSenseテクノロジーが様々な蛍光寿命でより多くの情報を抽出

14 高圧凍結装置
EM ICE

高圧凍結

氷晶を発生させることなく、最大厚み200 μm、直径5 mmまでの試料を凍結可能な高圧凍結装置です。

- 氷晶防止剤が不要
- 懸濁液や単層細胞培養、細胞組織の凍結固定が可能・凍結までの処理時間を短縮
- 再現性の高い凍結が可能・簡単なワンボタン操作
- LM/EMの相関をとるCLEM研究に最適
- 光刺激・電気刺激と連動した高圧凍結(オプション)

15 凍結置換装置
EM AFS2

凍結置換

光学顕微鏡や電子顕微鏡用の凍結置換と、低温下での樹脂包埋が可能です。

- 使用温度範囲:-140℃ ~+70℃
- トランスファー機能搭載
- 紫外線重合が可能
- 直感的なプログラミングが可能
- 凍結置換専用プロセッサ-FSPによりラボオートメーションを実現(オプション)

16 自動ルーチン用ティッシュプロセッサ
EM TP

固定 脱水 置換

- 安全性を向上
- 自動化によるタイムセービング
- 再現性を向上

17 自動臨界点乾燥装置
EM CPD300

臨界点乾燥

二酸化炭素の臨界点状態での自動乾燥処理が、固定した生物試料および含水材料を水の表面張力による変形を防ぎ、再現性良く構造保存性に優れた乾燥を行います。

- 全自動制御されたプロセスで、再現性の良い臨界点乾燥を実現。
- フィルターコンセプトによりCO2の消費量および処理時間の短縮が図れます
- 廃液分離装置内蔵で、安全で簡単に廃液処理が可能です
- 多彩な試料ホルダーにより生物試料、MEMSなどさまざまなニーズに合わせて乾燥できます

ライカマイクロシステムズ東京本社1階の体験ラボには、製品デモンストレーションを行なうためのデモルームがございます。製品のご購入を検討されているお客様は、ご予約のうえ、体験ラボへお越しください。



デモンストレーションルーム 1

- 超解像共焦点顕微鏡
- 蛍光寿命イメージング共焦点顕微鏡
- 蛍光イメージングシステム
- レーザーマイクロダイセクション

デモンストレーションルーム 2

- コンタミ解析装置
- デジタルマイクロスコブ
- 実体顕微鏡
- 半導体検査・大型XYステージ顕微鏡

デモンストレーションルーム 3

- トリプリーオンミリング装置
- 断面試料作製装置
- 真空クライオトランスファー装置
- 高真空コーティング装置
- 回転式マイクロトーム

デモンストレーションルーム 4

- Volume EM用ウルトラマイクロトーム
- ウルトラマイクロトーム
- クライオウルトラマイクロトーム
- 臨界点乾燥装置
- ガラスナイフメーカー
- トリミング装置

ショールーム

- デジタルマイクロスコブ
- 実体顕微鏡
- 正立顕微鏡
- 培養顕微鏡
- 金属顕微鏡



レクチャールーム



カフェスペース

アクセス



東京本社 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-29-9
 Tel: 03-6758-5656 (カスタマーサポート)
 Fax: 03-5155-4333
 E-mail: lmc@leica-microsystems.com
 最寄り駅 JR/西武新宿線 高田馬場駅 戸山口
 地下鉄東西線 高田馬場駅 5番出口

From Eye to Insight



最先端の精度で自動化を
インテグレーション

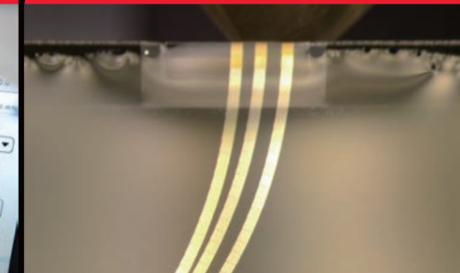
超薄切片作製用ウルトラマイクロトーム

UC Enuity

自動化技術でよりスマートに

すべての切片を有効に

安定した凍結切片作製を実現



- 起動時のイニシャライズを含め、各種自走系機能の設定を包括して、自動セットアップ
- 各種ソフトウェアパッケージでアプリケーションに合わせた機能追加できる拡張性
- 精密な温度制御とクライオチャンバーにより、凍結切片作製の安定性と操作性を継続
- クライオトランスファーシステムを使用したワークフローの接続が可能
- アレイトモグラフィ向け高品質リボン状超薄切片を、基板上に効率的に回収
- 蛍光実体顕微鏡観察像やμCTスキャンデータを用いたターゲットのトリミングなど、先進的な拡張性も